微纳光纤加热拉伸制备工艺的研究

周敏雯 李新碗

("区域光纤通信网与新型光通信系统"国家重点实验室,上海交通大学)

摘 要:本文对微纳光纤加热拉伸制备的工艺进行研究。在加热拉伸准备工艺方面,本文指出,干净地去除多层 涂覆层、火焰-光纤距离及流量调整、和夹具调整是影响微纳光纤损耗的重要因素;在加热拉伸过程工艺方面,本文 从预加热时间和拉伸速度两个角度进行研究,对参数进行优化处理。实验结果表明,通过本文所阐述的工艺进行微纳 光纤的制备,成品具有损耗较小,且可重复性较高的优点。

关键词:微纳光纤;光纤拉伸;预加热时间;拉伸速度

Research on the Fabrication of Micro-nano Fiber by Drawing

Zhpu Minwen Li Xinwan

(State Key Lab. of Adv. Opt. Commun. Syst. & Networks, Shanghai Jiao Tong Univ.)

Abstract: The fabrication of micro-nano fiber by taper drawing is addressed in this paper. In

The aspect of preparation of the fiber tapering, it was pointed out that complete removal of the multi-layer coating, fine adjustment of the fire-fiber distance/fire flux and proper adjustment of the clamps are the keys to make low-loss micro-nano fibers. For the process of the fiber taper drawing, the pre-heating time and stretching speed are carefully examined for parameter optimization. It is shown by experiments that the proposed scheme promises low-loss fibers with good reproducibility.

Key words: micro-nano fiber; fiber drawing; pre-heating time; stretching speed

0 引言

近年来,微纳光纤的拉伸制备技术成为一项微纳尺度 上的材料和光学研究的热点。这主要是因为微纳光纤能 产生较大的倏逝场,且具有较高的光功率密度等特性, 从而在实现高灵敏度的非线性光学器件方面,比如微纳光纤 环形结激光器和微纳光纤环形腔等,展现出无限的可能。

制备微纳光纤的常用方法是,通过热源对去掉涂覆 层的标准单模光纤的部分区域进行加热,使光纤软化, 再从加热区域的一端或是两端,进行手动或是机械拉伸, 从而使加热区域的光纤的物理尺寸变细,可得到直径仅 数百纳米的微纳光纤。文献^[1]首先公布了通过手动的两步 拉伸法成功制备出小直径低损耗微纳光纤的成果,向人 们展示了小直径低损耗微纳光纤制备的可能性,掀起了 这一方向的研究热潮。其后,文献^[1]的作者继续致力于微 纳光纤的手动制备方法的研究,又先后提出了自调制拉 伸法^[2]和块状玻璃直接拉伸法^[3]。与此同时,其他各科研 机构则纷纷尝试重复性更高的机械化制备方法,利用精 密电机控制微纳光纤的拉伸速度和力度,根据加热源不 同又可再分为火焰加热拉伸制备^[4](也就是传统制备方法 ^[5]、激光加热拉伸制备^[6]和电加热拉伸制备^[7]等。

然而现有的拉伸制备方式中都或多或少地存在着拉 伸附加损耗较大,拉伸结果可重复性较差的问题,这不 仅直接影响到了对微纳光纤诱人应用前景的进一步实 验研究,同时不利于微纳光纤今后的生产性批量制备。本文 对微纳光纤加热拉伸制备的准备和拉伸两个阶段的工艺 分别进行研究,通过对参数的优化处理,提出低损耗、 高重复性的微纳光纤加热拉伸制备工艺方案。

1 微纳光纤加热拉伸准备工艺

1.1 涂覆层去除工艺

无论是哪一种微纳光纤的加热制备方式,都需要首 先去除光纤的涂覆层。为了确保光纤涂覆层既具有足够 的柔韧性又具有较高的抗弯折强度,一般光纤厂商采用 双层涂覆,即内涂覆层采用较柔软的涂覆材料,用于保 护裸光纤表面免受机械损伤,并且在光纤使用中起到缓 冲外界应力的作用;外涂覆层采用硬质的涂料,有利于 光纤耐磨损。

当前,在实际生产中所采用的光纤涂覆层去除方法 一般有三种,即机械式、化学式和热力学机械式^[8]。通常 我们在进行光纤熔接端面处理的时候,采用普通的机械 式去除法就可以达到需要的去除涂覆层的效果。但是, 对于微纳光纤的制备准备则不然,这是由于去掉光纤涂 覆层包括去掉外涂覆层和内涂覆层,剥线钳主要用于去 掉硬质的外涂覆层,而柔软的内涂覆层与光纤结合得比 较牢固,剥线钳之类的机械方式无法将其彻底剥离,而 机械式去除法^[9-10]中"将酒精棉夹住光纤轻轻擦拭,力争 一次成功"的清洁方式仅可以去除被剥线钳破坏后的涂覆 层颗粒,却无法将依然黏附在光纤表面的内涂覆层彻底 清除干净。

由于诸如氟丙烯酸树脂涂覆层的沸点一般为80°C左 右,而诸如石英光纤包层的熔点一般为1000°C^[11],如果 光纤的涂覆层去除得不够干净,当用温度超过1000°C的 火焰对光纤进行加热后,内涂覆层片断和可能残留的外 涂覆层颗粒会与包层一起融熔并迅速汽化。残余的涂覆 层物质在短时间内发生物态性质的变化会导致光纤包层 受热不均匀,从而破坏其轴对称几何特征。而几何形状 不正则的锥形光纤容易激发出基模LP01和LP02之外的其 他复杂模式,造成能量损失,同时严重影响制备实验的 可重复性。

为了微纳光纤的加热拉伸制备,我们在使用剥线钳 剥离涂覆层后,清洁步骤不"力求一次成功"。在第一次 擦拭去除了残余颗粒物之后,换一块新的浸透无水乙醇 的棉胚以一定力度夹住光纤,沿X轴向以非常缓慢的速度 擦拭第二次,令光纤被溶解液充分浸润,以保证残余的 内涂覆层能够被全方位地充分溶解并随之擦除。然后再 使用新的无水乙醇棉胚沿Y轴进行第三次擦拭,速度中等 即可。三次擦拭后,可以认为微纳光纤制备前去除涂覆 层的预处理完成。

1.2 火焰-光纤距离及流量

火焰-光纤距离的控制是光纤加热拉伸准备阶段较容 易被忽视的一个影响因素。以我们的使用氢气火焰的实 验装置为例,火焰形状及其喷头如图1(a)所示。氢气火焰 可以分成两个区域,外层呈蓝色,是氢气与氧气燃烧的 颜色,温度最高;内层则呈现出红色荧光,那是接触不 到氧气或者与氧气燃烧不充分的剩余氢气在外层高温火焰 的烘烤下呈现出的颜色。根据我们的研究和摸索实验, 当火焰-光纤距离使得光纤加热段主要处于火焰的内焰部 分时如图1(b)所示,由于该部分温度不够高,光纤的熔融 程度较差,会导致夹具打滑而无法正常拉伸; 当火焰~光 纤距离使得光纤加热段处于火焰的外焰部分时如图1(c)所 示,火焰的温度可以支持拉伸所需的熔融状态。但是需 要注意的是,根据文献[5]中对光纤拉伸的分析,加热段越 长则拉伸效果越好,于是我们在选择火焰--光纤距离的时 候存在一个最佳区间,即可以使光纤加热段处于外焰靠 近其与内焰分界线区域的距离。

同时,在氢气流量的控制方面也有着一个最佳的选择 范围。这是因为当氢气流量较大时,会导致火焰附近气 流的稳定度下降,进而使微纳光纤在接近成品时的微纳 直径下容易断裂;而当流量较小时,火焰也随之减小, 加热段随之变短,以致损耗变大、也容易造成断裂。



1.3 夹具调整架

微纳光纤拉伸制备前的准备工艺中,另外一个重要 的因素是被拉伸光纤固定夹具位置的调整。希望微纳光纤 制备实验成功率高、成品性能好,就需要在实验进行之前 利用光学精密调整架使得固定光纤的两侧夹具槽处在一 条直线上。在我们进行过的大量摸索实验中可以发现, 当光纤的固定位置不够平直时会使得其受热区域受热不 均,而受热不均则会导致光纤加热段熔融程度不足、夹 具打滑无法正常拉伸,或者因为熔融段过短而令光纤损 耗剧增且易断。

2 准备工艺的实验结果

为了对比上述准备工艺对微纳光纤加热拉伸制备结 果的影响,我们进行了实验验证。

实验采用图2所示的传统加热拉伸制备微纳光纤的装置。X、Y两个步进电机上分别承载光学精密调整架,其上固定光纤夹具,将光纤中两端分别固定在夹具上,使得去掉涂覆层部分的一段处于火焰头下方。氢气发生器所

产生的氢气通过流量控制仪的控制被匀速地输送到火焰 头的部位,在该处被点燃后成为稳定的加热源。PC机通 过RS232协议与步进电机控制器建立通信,在PC机上编 写应用程序帮助实验者简便而精确地控制步进电机的拉 伸长度、速度以及加速度等运动参数。当光纤被火焰加 热后处于熔融状态时,两个步进电机按照PC的指令分别 向两侧拉伸光纤,使其伸长变细。光纤的一端接在光源 上,另一端连接功率计,可以实时观测到拉伸过程中损 耗增加的情况。

在实验中,我们统一其他参数,取单边步进电机拉 伸速度700p/s,长度70000p。(本实验中采用的步进电机 1p=0.319µm)



在实验1中,我们的光纤加热拉伸准备工艺处于摸索 阶段,其实验结果见图3;实验2中则对上述准备工艺进 行了有针对性的选择和充分的保障,其实验结果见图4。



图4 加热拉伸准备工艺完善后的结果

根据统计分析可得,常用机械式去除涂覆层方法的 实验结果中,光纤因拉伸过程产生的附加损耗平均为 0.322dB,平均值的标准偏差为0.060dB,因此,实验1的 损耗增量结果可写为0.320±0.060dB,进一步分析可得 95%置信区间为(0.203,0.440)dB。

同样地,经过统计分析,改良的去除涂覆层方法的 实验结果中,光纤因拉伸过程产生的附加损耗平均为 0.045dB,平均值的标准偏差为0.007dB,因此,实验2的 损耗增量结果可写为0.045±0.007dB,其95%置信区间为 (0.031,0.058)dB。

可以看到,遵循上述微纳光纤加热拉伸准备工艺后 的制备结果,其附加损耗明显减小,且重复性明显增强。

3 微纳光纤加热拉伸过程工艺

在满足加热拉伸准备工艺的前提下,我们对微纳光 纤加热拉伸的工艺过程进行了进一步的实验研究。

3.1 实验装置升级

为了研究拉伸过程中氢气火焰预加热时间对拉伸结 果的影响,我们对实验的软硬件装置同时进行了升级。 在硬件方面,我们在氢气火焰下添加了行程轨迹垂直于 被拉伸光纤所在直线的步进电机Z,并在控制器中增添上 相应的控制模块,使其能够对步进电机Z发送控制指令。 而在软件方面,则专门编写了预加热控制的功能模块, 对火焰的上火、加热以及退火等一系列动作及其时间进 行控制。

3.2 不同预加热影响的实验结果

比较不同预加热时间的实验结果如图5所示。其中统一其他参数为单边步进电机拉伸速度700p/s,拉伸长度7000p。



图5(b) 不同预加热时间的实验结果(2000ms)

值得注意的是,随着预加热时间的增长,预加热过 程所受到的外界干扰因素增多,拉伸后的附加损耗较大 且波动幅度也较大。但是预加热时间也不能一味求短, 因为实验表明,当预加热时间在500ms附近时,可能会发 生光纤的熔融程度不足,因而造成光纤夹具打滑,拉伸 失败。从数据来看,选择2000ms的预加热时间可以达到 低损耗、高稳定度的实验期望。

3.3 不同速度影响的实验结果

比较不同拉伸速度的实验结果如图6所示。其中统一 其他参数为火焰预加热时间3500ms,单边步进电机拉伸 长度70000p。





图6(b) 不同拉伸速度的实验结果(1100p/s)

根据分析和实验结果,我们知道,和预加热时间相 对应地,随着拉伸速度的减慢,拉伸过程中所受到的外 界干扰因素增多,拉伸后的附加损耗较大且波动幅度也 较大。但是拉伸速度也不能一味求快,因为过快的拉伸 速度和过短的预加热时间一样,也会导致光纤的熔融程 度不足,因而造成光纤夹具打滑,拉伸失败。从实验结 果来看,1100p/s的拉伸速度是一个比较适宜的选择。

3.4 两优值同时作用的结果及分析

将两个较优值同时采用,以2000ms的预加热时间和 1100p/s的拉伸速度进行实验,得到的结果如图7所示。



根据统计分析可得,两个较优值同时作用的实验结 果中,光纤因拉伸过程产生的附加损耗平均为0.010dB, 平均值的标准偏差为0.003dB,因此,实验1的损耗增量 结果可写为0.010±0.003dB,进一步分析可得95%置信区 间为(0.003,0.016)dB。

这些数据表明,在上述参数设定的综合作用下,微 纳光纤的拉伸制备呈现出相当低的附加损耗以及很高的 可重复性。

4 结语

本文对微纳光纤加热拉伸制备的工艺进行了研究, 提出了在加热拉伸准备阶段和加热拉伸过程中的重要工 艺技术点。通过反复实验与总结证明,在微纳光纤加热 拉伸制备中,做好加热拉伸的各项准备,与优化调整加 热拉伸过程中的参数同样重要。一般而言,涂覆层去除 工艺以及拉伸过程中的火焰预热和拉伸速度等因素,是 减小微纳光纤损耗的关键因素。本文为微纳光纤加热拉 伸制备领域的技术人员提供了简单易操作的详细工艺说 明,在微纳光纤制备技术领域中具有较高的实用价值。

参考文献:

[1] Tong, LM, Gattass R R, Ashcom J B, et al. Subwavelength-diameter silica wires for low-loss optical wave guiding [J]. Nature, 2003, 426 (6968): 816-819.
(下接60页)

- [5] UG197 (v1.0).PCI Express Endpoint Block User Guide[G]. 2006.
- [6] UG196 (v1.2).Virtex-5 RocketIO GTP Transceiver User Guide[G]. 2007.

作者简介:

周轶男, 江南计算技术研究所, 高级工程师

- 电话: 0510-85155422; 13861794927
- 电子信箱: zhou_register@126.com
- 通信地址: 江苏省无锡市33号信箱421号收(214083)

(上接82页)

- [2] Tong L M, Lou J Y, Ye Z Z, et al. Self-modulated taper drawing of silica nanowires [J]. Nanotechnology, 2005, 16 (9): 1445-1448.
- [3] Tong L M, Hu L L, Zhang J J, et al. Photonic nanowires directly drawn from bulk glasses [J]. Optics Express, 2006, 14 (1): 82-87.
- [4] Brambilla G, Finazzi V, Richardson D J. Ultra-lowloss optical fiber nanotapers [J]. Optics Express, 2004, 12 (10): 2258-2263.
- [5] Payne FP, Mackenzie H S. Novel applications of monomode fibre tapers [C]. Proceedings of SPIE, Fiber-Optic Metrology and Standards, 1991, 1504: 165-175.
- [6] Sumetsky M, Dulashko Y, Hale A. Fabrication and study of bent and coiled free silica nanowires selfcoupling microloop optical interferometer [J]. Optics Express, 2004, 12 (15): 3521-3531.
- [7] Lei Shi, Xianfeng Chen, Hongjuan Liu, et al.
 Fabrication of submicron-diameter silica fibers using electric strip heater [J]. Optics Express, 2006, 14 (12): 5055-5060.
- [8] 彭仁翔,周次明,朱海红.TEA CO2激光去除光纤 涂敷层的实验研究[J].激光技术,2005,29(6): 670-672.
- [9] 陈楠. 光纤网络常用的仪器使用方法及注意事项 [J]. 西部广播电视, 2002, (12): 32-33.
- [10] 黄枢. 光纤端面处理与熔接质量对光纤激光器输 出功率的影响[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报, 2007,6(B06): 14-18.
- [11] 李刚, 欧书方, 徐剑. 石英光纤涂层材料[J]. 涂料技术与文摘, 2008, (6): 2-5, 14.

作者简介:

周敏雯,上海交通大学电子工程系,硕士研究生 手机:13482558078

- 电子信箱: zu365@163.com
- 通信地址:上海市闵行区东川路800号上海交通大学 电信群楼5号楼200B室(200240)